# UCN偏極膜の冷中性子反射率測定 2021.07.13 - 2021.07.15

2021-07-12

樋口 嵩

## 測定の概要

- 測定の目的:
  - シリコン基板スパッタ鉄膜のUCN偏極膜への応用: 冷中性子反射率測定による性能評価 が可能であることがメリット
  - ・ 本測定: 異なる成膜条件の20 x 30 mm<sup>2</sup> のシリコン基板鉄膜サンプルでプロトタイプ 測定。実際に以下の物理量を測定から抽出できることを実証することを目指す:
    - 磁化に必要な磁場の値 (H<sub>c</sub>, H<sub>s</sub>)
    - 完全磁化したときの磁気依存ポテンシャル (μ<sub>n</sub>B<sub>sat</sub>)
    - 鉄膜厚み (VSMデータの較正に必要, →次ページ)
- スケジュール大枠
  - 7月13日 セットアップ、アラインメント調整, 偏極度測定
  - 7月14日 試料の測定
- 試料一覧:
  - a) Fe 30nm
  - b) Fe 50 nm
  - c) Fe 90 nm
  - d) S45C 50 nm

→ 時間があれば

e) Fe 4.2 um

(3分 x 2偏極パターン x 磁場9条件 = 54分/試料)

# 1日目(7/13)前半

- 一日目の目標: 最低でも偏極率測定まで、できればサンプルaの測定
- 残りの実験要素(上流および下流ミラー、スピンフリッパー)を設置 (1h) (検出器はまだ設置しない)
- 磁気ミラーのアラインメントおよびスピンフリッパー・電磁石制御系準備 (4h)

### アラインメント (市川、川崎、赤塚) (4h)

- 水準器等で数ミリ単位で位置合わせ
- レーザーでアラインメントの調整
- 上流からのレーザーでミラーの角度調整

#### **制御系準備(三島、樋口、今城)** (4h)

- スピンフリッパー制御 (2.5h)
  - DC電源動作テスト
  - DC電流値設定 (ヒステリシスに注意)、磁気プローブで測定して確認
  - RF電源動作テスト
  - RF電流値較正
- 電磁石制御 (1h)
  - ・ 電源動作テスト
  - 電流値較正
- DAQに組み込み (0.5h)

- 偏極度測定準備 (3h)
  - 磁気ミラー、フリッパー、電磁石を設置した状態で磁気プローブで磁場測定 (1h)
    - DC磁場がRFコイル内で共鳴点を通過しているか確認
  - 検出器設置 (0.5h)
  - ビームを出して、アラインメント再調整 (1.5h)
    - 検出器の位置調整
    - ミラーの微調整
    - スリット調整

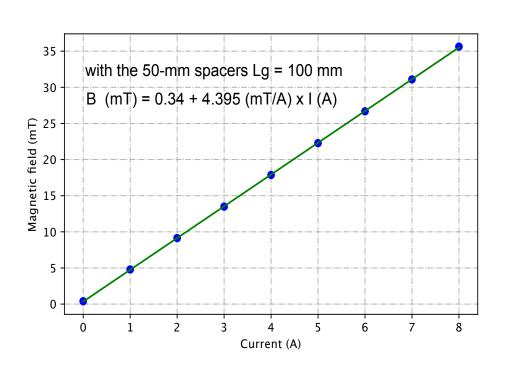
# 1日目(7/13)後半

- 偏極率測定 (1.6h)
  - バックグラウンド測定(0.1 h)
  - 偏極ミラーの偏極度測定(SF OFF) (1h) ダイレクトビームを測る必要はないか、事前に確認(測るなら一旦ミラーを外すことになる)
  - SFにスピン反転率測定 (0.5h)
- サンプルa 測定準備 (2.6h)
  - 下流の偏極ミラー取り外しサンプルa設置 (0.5h)
  - 再アライメント・角度調整 (2h)
    - レーザーでアラインメント確認
    - ビームで角度微調整
  - Test run (0.1h)
- サンプルa測定 overnight run (11h)

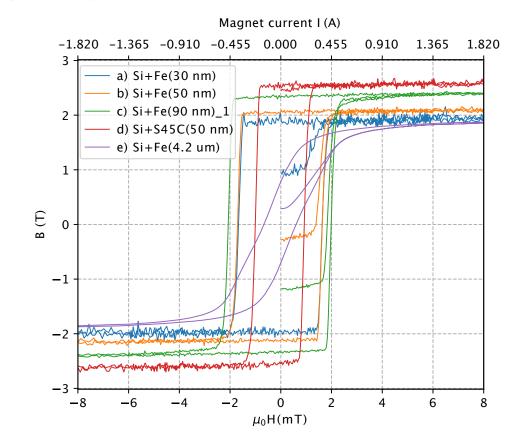
## 2日目(7/14)

- サンプルb 測定(計3.7 h)
  - 試料取替 (0.5h)
  - アラインメント再調整 (1h)
    - レーザーによるアラインメント (0.4 h)
    - 中性子ビームによるアラインメント (0.4 h)
    - スリット調整 (0.2h)
  - Test run (0.2h)
  - 測定 (2h)
- サンプルc 測定(計3.7 h)
  - 試料取替・調整(同上 1.5h)
  - Test run (0.2h)
  - 測定 (2h)
- サンプルd 測定(計3.7 h)
- サンプルe 測定(計3.7 h)

## 電磁石の励磁直線・試料の磁化特性



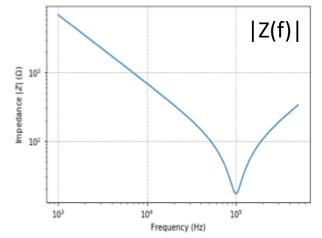
- 電磁石: 1A (磁場4.3 mT)でほぼ完全飽和
- 保磁力の定義
  - Hc := BHカーブとB=0の交点
  - Hs := B<sub>st</sub> の95%に対応する H (飽和させるのに必要な磁場)
- BH カーブの縦軸を磁束密度に変換する際に試料の体積が必要  $\rightarrow$  厚みの見積もりの誤差が  $B_{sat} > 2T$  の原因



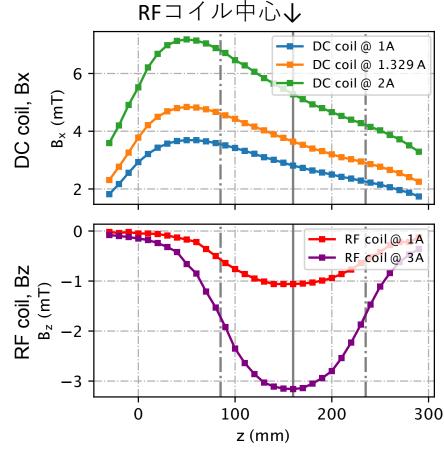
Sample	Hc (Oe)	Hs (Oe)	Bs (Oe)
a) Si+Fe(30 nm)	16. 5	29.8	21553
b) Si+Fe(50 nm)	16.7	24.5	22373
c) Si+Fe(90 nm)	20.30	45.5	24879
d) Si+S45C(50 nm)	9.65	20.5	27402
e) Si+Fe(4.2 um)	6.33	66.8	19297

## AFP spin flipper パラメータ(赤塚くん資料参照)

- RFコイル
  - 共鳴周波数 fc = 106.3 kHz <-> B<sub>z</sub> = 3.645 mT
  - $|Z (f=fc)| = 17 \Omega$
  - $B_{z, RF}(z=160 \text{ mm})=-1 \text{ mT/A} * I_{RF}(A)$

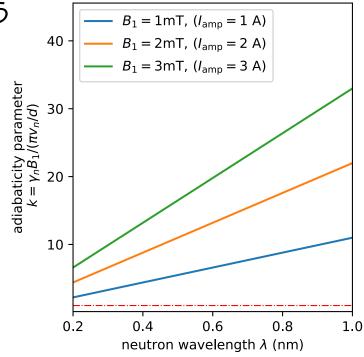


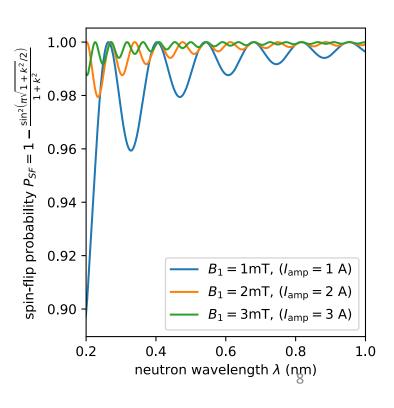
- DCコイル
  - Bx, DC(z=160 mm) = 2.503 mT/A \*  $I_{DC}$  (A)+ 0.332 mT (ただしヒステリシスあり)
  - 磁場0から上げていった時、 $I_{DC} = 1.329$  A でRFコイル中心で Bx = 3.645 mT 達成



# AFP spin-flipper スピン反転率見積もり

- RFコイル電流: I<sub>pp</sub> = 2A <-> I<sub>amp</sub> = 4A まで使用可能
- <u>Grigoriev et al.</u>に基づき、 adiabaticity parameter k とスピン反転率を見積もり (RFコイル長さ d = 0.15m)
  - ⇒ I<sub>amp</sub>= 2 A くらいはほしいところ
- $B_0 = 3.645 \text{ mT}$  をこえないためには  $B_{RF} < 3 \text{ mT} < -> I_{amp} < 3A$
- 回転磁場の変わりに振動磁場を使う ので 振幅1/2
- I<sub>amp</sub> = 2A (I<sub>pp</sub>=4A) が適切



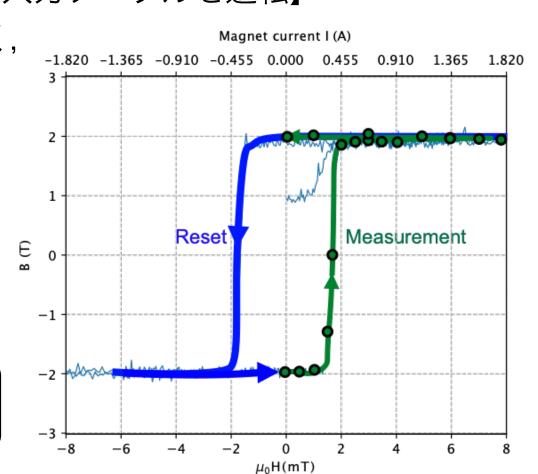


## 測定手順(それぞれの試料について)

- 試料設置·位置調整
- 測定前に H = 2A (負の向きに磁化させる)【エリアに立ち入って電磁石の入力ケーブルを逆転】
- 磁場 {H<sub>i</sub>} にそって磁場を上げていく, それぞれの磁場印加値に対して
  - 上偏極の時の反射率(SF: OFF)
  - 下偏極の時の反射率(SF: ON) を測定

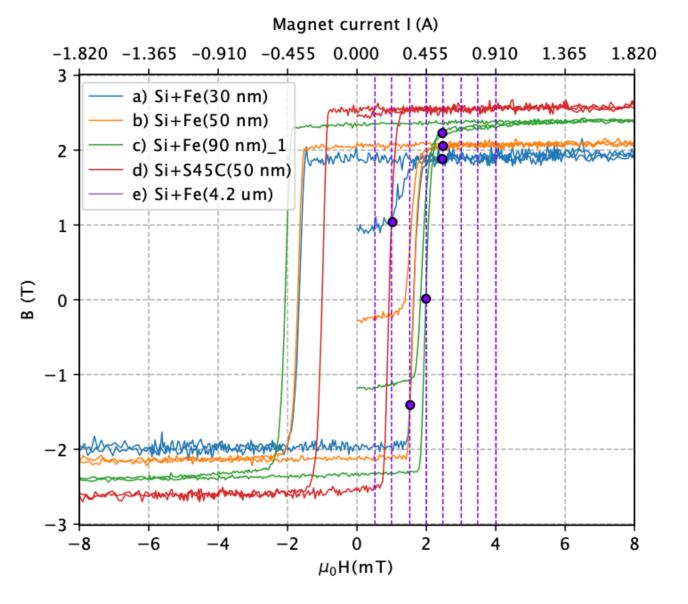
{H<sub>i</sub>} ={0, 0.5,1.0, ···, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 3.0, 1.0, 0.0 mT} (仮)

- 立ち上がりの前後(Hc前後)を取りたい
- 完全に立ち上がったところを取りたい



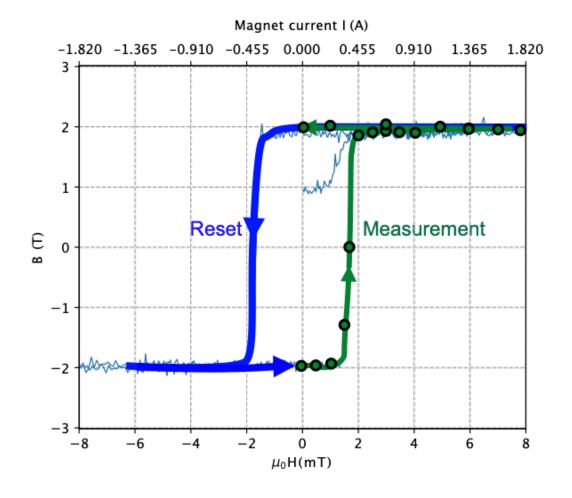
0 0.0 0.000000 0.5 0.036405 2 1.0 0.150171 3 1.5 0.263936 4 2.0 0.377702 0.491468 3.0 0.605233 7 3.5 0.718999 8 4.0 0.832765 5.0 1.060296 **10** 6.0 1.287827 **11** 7.0 1.515358 **12** 8.0 1.742890 5.0 1.060296 **14** 3.0 0.605233 1.0 0.150171 0.0 0.000000

# 磁場印加值候補



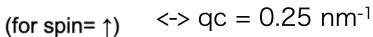
■ 0.5 mT 刻みで試料ごとのHc付近の立ち上がりの違いを見分けられるはず

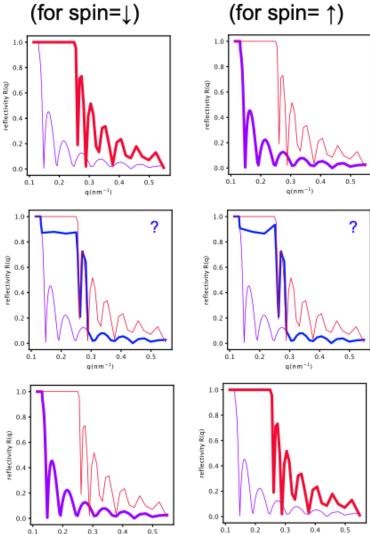
### 予想される信号





- B= 2T, V = 88.4 neV<-> qc = 0.13 nm<sup>-1</sup>
- B = -2T, V= 329.6 neV





## 中性子波長スペクトル・測定時間見積もり

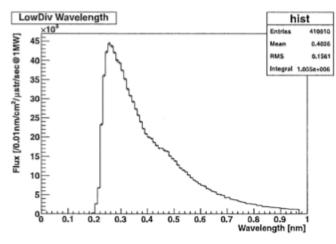
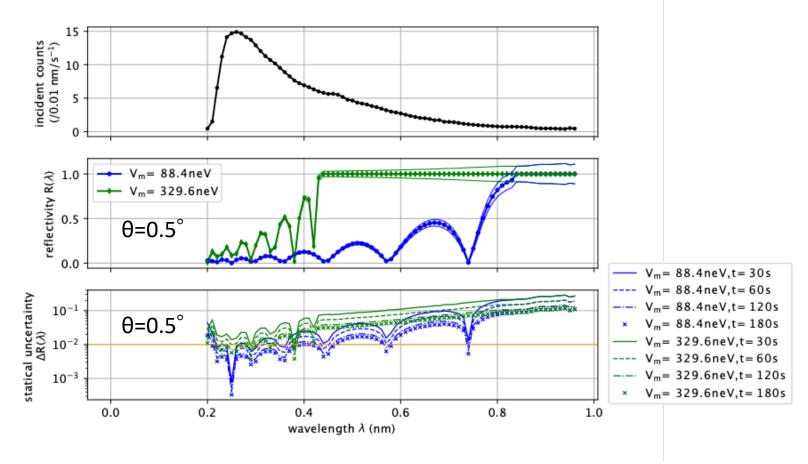


Fig. 10 A spectrum of neutron wavelength at the exit of Low-Divergence beam branch in beam spot of 30 mm × 1 mm.

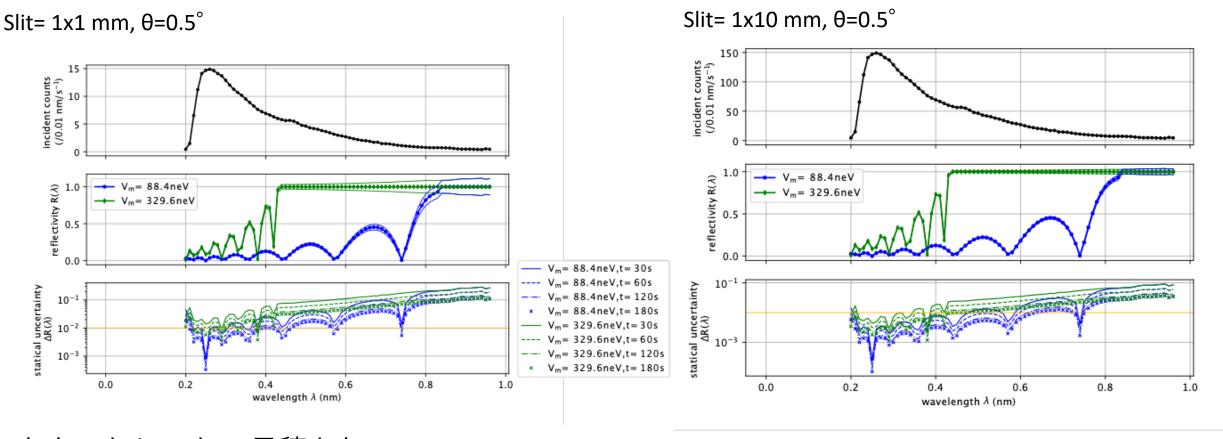
https://doi.org/10.5611/hamon.25.2\_156



- カウントレートの見積もり
  - ビームを 1 x 10 mm² (= 0.1 cm², <-> 0.03 µstr)に絞るとすると
    ⇒ 全波長域積分で 10 kcps 程度
- 反射ビームのカウント見積もり
  - t=180 s で 主な 波長域で 誤差 < 1%

(すべて Bin幅 **0.01 nm** ) (ミラーの反射率波長依存性は無視している)

# 中性子波長スペクトル・測定時間見積もり

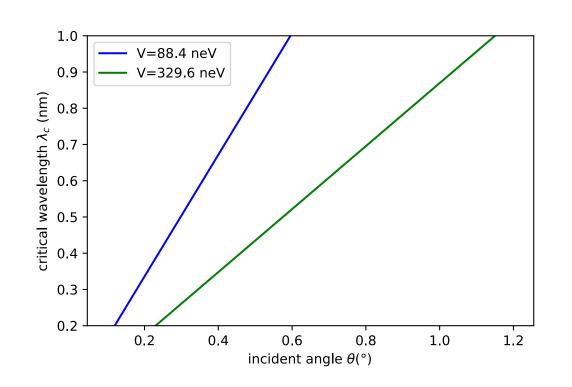


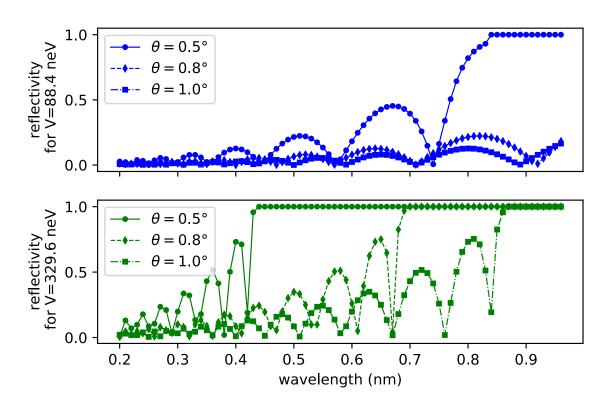
- カウントレートの見積もり
  - ビームを 1 x 10 mm² (= 0.1 cm², <-> 0.03 µstr)に絞るとすると
    ⇒ 全波長域積分で 10 kcps 程度
- 反射ビームのカウント見積もり(slit: 1mmx10mmの場合)

• t=180 s で 主な 波長域で 誤差 < 1%

(すべて Bin幅 **0.01 nm**) (ミラーの反射率波長依存性は無視)

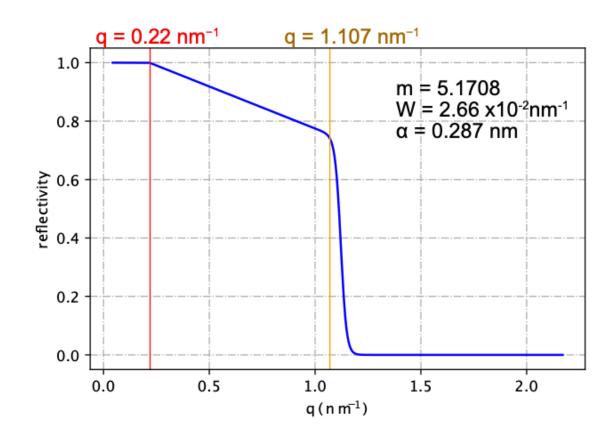
## 入射角の検討

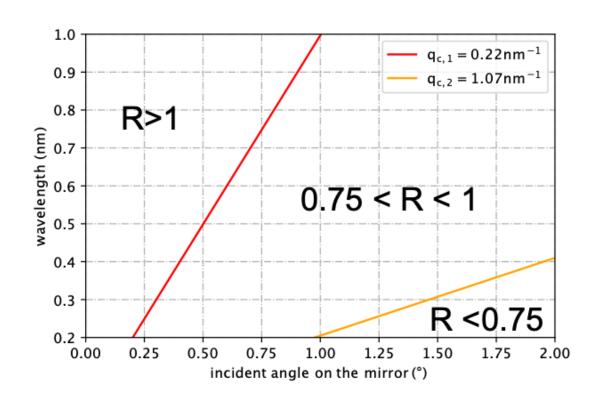




- 低発散ブランチの波長域に臨界波長が収まるためには 0.22°< θ < 0.6°
- カウントの低い高波長テールに臨界波長があたるのは不利なため、< 0.5°が望ましい

## 磁気ミラー入射角の検討





■ 過去にBL05で測定された寿命実験用磁気ミラーの反射率特性を参照 (m~5)

(横橋 麻美,修士論文,名古屋大,2017)

■ *θ* < 1° ならば全波長域でR>0.75、さらに小さければなお良い

# 磁気ミラー透過後のスペクトル

